(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-9171

(43)公開日 平成7年(1995)1月13日

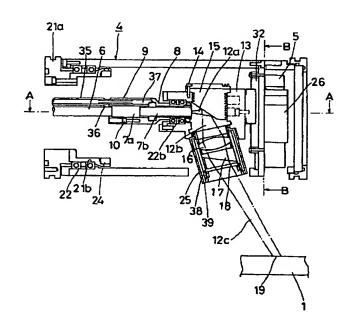
(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
B 2 3 K	26/00	E			
		G			
	26/06	Α			
		G			
G01N	21/88	. В	8304-2 J		
				審査請求	未請求 請求項の数4 OL (全 6 頁)
(21)出願番号		特願平5-154920		(71)出願人	000003078
					株式会社東芝
(22)出願日		平成5年(1993)6月25日			神奈川県川崎市幸区堀川町72番地
				(72)発明者	河野 涉
•					東京都府中市東芝町1番地 株式会社東芝
•					府中工場内
				(72)発明者	木村 盛一郎
					東京都府中市東芝町1番地 株式会社東芝
					府中工場内
				(74)代理人	弁理士 則近 憲佑

(54) 【発明の名称】 管内面レーザ表面処理装置

(57)【要約】

【目的】 本発明は、レーザ加工点からの反射光による 各種光学部品等の損傷を防ぎ、幅広い表面処理層を得る ことができ、安定した加工が可能であり、さらに加工の 信頼性を高めることを目的とする。

【構成】 光学系におけるミラー15は管内面に対し所 定角度に設置し、レンズは凸レンズ16とプリズムレン ズ17を組合わせ使用して光ファイバ6出射部への加工 点19からのレーザビームの反射光の戻りを防ぐように 構成したことを特徴とする。



10

30

【特許請求の範囲】

【請求項1】 レーザ光を伝送する光ファイバの出射部に、ミラー及びレンズを組合わせた光学系を取付けて管内面の加工点にレーザビームを照射する管内面レーザ表面処理装置において、前記ミラーは前記管内面に対し所定角度に設置し、前記レンズは凸レンズとプリズムレンズを組合わせ使用して、前記出射部への前記加工点からのレーザビームの反射光の戻りを防ぐように構成してなることを特徴とする管内面レーザ表面処理装置。

1

【請求項2】 前記プリズムレンズは、シリンドリカルプリズムレンズを使用して、前記レーザビームは前記加工点において楕円ビームを形成するようにしてなることを特徴とする請求項1記載の管内面レーザ表面処理装置。

【請求項3】 前記光学系と前記管内面の加工点との間の距離を測定するハイトセンサを有することを特徴とする請求項1記載の管内面レーザ表面処理装置。

【請求項4】 シールドガス導入用のガス導入管を前記 光ファイバに並設し、当該ガス導入管から導入したシー ルドガスを前記出射部及び光学系近傍を通過させて当該 20 出射部及び光学系を冷却したのち前記管内面の加工点に 放出するように構成してなることを特徴とする請求項1 記載の管内面レーザ表面処理装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、例えば原子炉配管や熱 交換器等配管の内面に発生した欠陥の補修や予防保全等 において、遠隔操作でその管内面に円周方向等にレーザ 照射を行って表面処理する管内面レーザ表面処理装置に 関する。

[0002]

【従来の技術】従来、原子炉配管や熱交換器等配管に発 生した欠陥の補修や欠陥発生の予防保全において遠隔操 作レーザ溶接及び表面処理を用いる場合、光ファイバに よって伝送された光を凸レンズ等で集光し、ミラーで折 り返して管内面にレーザビームを照射する方法が実施さ れている。これを図8で説明すると、加工ヘッド51を 図示しない配管内駆動装置によりレーザ照射位置にまで 挿入し、光ファイバ52より出射されたレーザビーム5 3 a を 2 枚の凸レンズ 5 4 a, 5 4 b で集光し、ミラー 40 55で折り返して配管56の内面に垂直に照射し、加工 ヘッド51を回転させて配管内面を周方向にレーザビー ム53bを走査させる。加工点のシールド及びスパッタ ・ヒューム等のミラー55への付着防止のために、加工 ガスを加工ヘッド51外部に設けられた加工ガス噴出口 57からレーザ照射位置58へ横方向に吹き付けてい る。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】レーザビームを金属表 光学系を構面に照射する場合、レーザビームは金属表面で反射され 50 能となる。

2

る。特に、レーザ表面処理では反射が大きく、レーザビーム53bを配管56内面に垂直に照射すると、反射光は加工ヘッド51及びミラー55に照射され、各部の損傷を招く。また、ミラー55によって反射光が折り返され、加工ヘッド51内部および凸レンズ54a,54b、光ファイバ52の損傷が考えられる。さらに、加工ヘッド51の軸ずれや配管56の偏心等によって、ミラー55の表面と配管56内面との距離に変化が生じた場合、光ファイバ52、凸レンズ54a,54b、ミラー55は加工ヘッド51に固定されているため、距離の制御ができず、安定した加工を行うことが困難である。また、加工ガスは加工ヘッド51外部の加工ガス噴出また、加工ガスは加工ヘッド51外部の加工ガス噴出また、加工ガスは加工ヘッド51外部の加工ガス噴出57から吹き出されるため、凸レンズ等の冷却ができず、凸レンズ54a,54bの加熱による損傷が考えられる。

【0004】そこで、本発明は、レーザ加工点からの反射光による各種光学部品等の損傷を防ぎ、幅広いレーザ表面処理層を得ることができ、安定した加工が可能であり、さらには装置故障を防止して加工の信頼性を高めることのできる管内面レーザ表面処理装置を提供することを目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するために、本発明は、第1に、レーザ光を伝送する光ファイバの出射部に、ミラー及びレンズを組合わせた光学系を取付けて管内面の加工点にレーザビームを照射する管内面レーザ表面処理装置において、前記ミラーは前記管内面に対し所定角度に設置し、前記レンズは凸レンズとプリズムレンズを組合わせ使用して、前記出射部への前記加工点からのレーザビームの反射光の戻りを防ぐように構成してなることを要旨とする。

【0006】第2に、上記第1の構成において、前記プリズムレンズは、シリンドリカルプリズムレンズを使用して、前記レーザビームは前記加工点において楕円ビームを形成するようにしてなることを要旨とする。

【0007】第3に、上記第1の構成において、前記光学系と前記管内面の加工点との間の距離を測定するハイトセンサを有することを要旨とする。第4に、上記第1の構成において、シールドガス導入用のガス導入管を前記光ファイバに並設し、当該ガス導入管から導入したシールドガスを前記出射部及び光学系近傍を通過させて当該出射部及び光学系を冷却したのち前記管内面の加工点に放出するように構成してなることを要旨とする。

[0008]

【作用】上記構成において、第1に、ミラーは管内面に対し所定角度に設置し、レンズは凸レンズとプリズムレンズを組合わせ使用することにより、出射部へのレーザ加工点からのレーザビームの反射光の戻りが防止されて光学系を構成する各種光学部品等の損傷を防ぐことが可能となる。

10

20

【0009】第2に、プリズムレンズをシリンドリカル プリズムレンズとして加工点に楕円ビームを形成するこ とにより、幅広いレーザ表面処理層を得ることが可能と

【0010】第3に、ハイトセンサを用いて光学系と加 工点との間の距離を測定し、この測定結果を基に加工点 までの距離を制御することにより、安定した表面加工が 可能となる。第4に、シールドガスを用いて出射部及び 光学系を冷却することにより、装置故障が防止されて加 工の信頼性を高めることが可能となる。

[0011]

【実施例】以下、本発明の実施例を図面に基づいて説明 する。図1乃至図3は本発明の第1実施例を示す図であ る。図1は管内面レーザ表面処理装置の内部構成を示す 断面図、図2は図1のA-A方向から見た図、図3は図 1のB-B方向から見た図である。本実施例の管内面レ ーザ表面処理装置の構成を作用とともに説明する。図1 に示す管内面レーザ表面処理装置を図示しない配管内駆 動装置を用いて、配管1内に挿入する。挿入時には、図 3に示すハロゲンランプ2によって前方を照らし、配管 前方モニタ用CCDカメラ3によって位置を確認し、配 管1内に予め定められたレーザ表面処理部近傍に管内面 レーザ表面処理装置を挿入する。その位置で、図示しな い心出し機構によって、配管1と加工ヘッド4の中心軸 を合わせる。次に、図3に示すレーザ照射部モニタ用C CDカメラ5を用いて配管1内面をモニタし、レーザ表 面処理部に正確に位置決めを行う。図1において、光フ ァイバ6の光軸方向の位置決めは、光ファイバ出射部に 設けられたスリーブ?a,?bをファイバホルダ8に挿 入後、ストッパ9をファイバホルダ8にネジ10で固定 30 する。そして、ストッパ9の爪にスリーブ7aが当たる まで光ファイバ6を出射方向の逆方向にスライドさせ て、図2に示すネジ11でスリーブ7aを固定する。ま た、スリープフaの外径はストッパ9及びファイバホル ダ8の内径にスリ合う状態であり、光軸のずれが起らな いようになっている。

【0012】光ファイバ6から出射されたレーザビーム 12 a は、ミラーホルダ13と押さえネジ14によって 保持されたミラー15の表面で折り返され、レーザビー ム12 bとなる。ミラー15の表面角度は、レーザビー ム12 bが配管1内面に対して15°傾斜するように設 定してある。レーザビーム12bは、凸レンズ16とシ リンドリカル・プリズムレンズ17と保護ガラス18を 介して、配管1内面に照射される。レーザビーム12c は、シリンドリカル・プリズムレンズ17によって、さ らに12.8°屈折され、配管内面に対して合計27. 8°傾斜して照射される。これによって、レーザ照射部 (加工点) 19からの反射光が加工ヘッド4を損傷する ことと光ファイバ6の出射部への反射光の戻りを防止す る。さらに、レーザ照射部モニタ用CCDカメラ5でレ 50

ーザ照射部19をモニタすることを可能とし、レーザ照 射時の加工状態を監視することができる。また、幅の広 いレーザ表面処理層を得るために、レーザピーム12c は凸レンズ16及びシリンドリカル・プリズムレンズ1 7によって楕円形状に成形されており、レーザ照射部1 9において配管1の周方向が短径、周方向の直角方向が 長径となる楕円ピームを形成している。

【0013】加工ヘッド4の自転は、図2に示す第1モ ータ20が駆動源となる。図1に示す加工ヘッド支持具 21 aは、図示しない配管内駆動装置に固定されてお り、加工ヘッド支持具21bと加工ヘッド4の間にボー ルベアリング22が設けられて、加工ヘッド4の回転を 可能としている。加工ヘッド4に固定された第1モータ 20の回転力が歯車23を介して、加工ヘッド支持具2 1に固定された内歯24に伝達され、内歯24の内周を 歯車23が自転しながら回転することで、加工ヘッド4 は自転する。また、加工ヘッド4が自転することによる 光ファイバ6のねじれを防ぐために、ファイバホルダ8 とミラーホルダ13の間にボールベアリング22bを設 けて、光ファイバ6と加工ヘッド4の自転を分離してい る。

【0014】図1に示すレンズホルダ25と配管1の内 面までの距離を制御する手段は、図3に示すハイトセン サ26を用いて配管1の内面までの距離を測定し、その 値を基にレンズホルダ25を取り付けているミラーホル ダ13を上下させて行う。ハイトセンサ読み取り位置2 7とレーザ照射部中心2.8は13mm程度ずれているた め、測定値を図示しないコントローラで補正する。図2 に示す第2モータ29の回転は歯車30を介して、ミラ ーホルダ13に固定されたラック31に伝達され、加工 ヘッド4に固定されたリニアガイド32に沿って、ミラ ーホルダ13は上下動する。このとき、取付金具33で 加工ヘッド4に取り付けられた近接スイッチ34によっ て、ミラーホルダ13の移動量を測定し、図示しないコ ントローラで移動量を制御する。

【0015】加工ガス(シールドガス)は、図1に示す ように外部からチューブ35によって加工ヘッド4内に 導入され、ストッパ9に取り付けられた加工ガス導入管 36を通り、加工ガス通過路37及びファイバホルダ8 とスリーブ7bの隙間を通ってミラーホルダ13の内部 へ放出される。このとき、光ファイバ6の出射部及びミ ラー15を冷却する。ミラー15は冷却効率を高めるた めに、フィンが切られている。ミラーホルダ13内部に 放出された加工ガスは、レンズホルダ25に設けられた 加工ガス通過路38を通過し、レンズホルダ25を冷却 して、多数の出射口39から放出され、レーザ照射部1 9近傍をシールドする。加工ガスはレーザ照射に先立っ て放出し、十分な雰囲気を形成した後、レーザを照射 し、それと同時に加工ヘッド4を自転させて配管1の内 面円周方向にレーザ表面処理を行う。加工中、レンズユ

ニット25と配管1の内面までの距離を一定に保つよう に制御し、安定したレーザ表面処理を行う。

【0016】次いで、図4には、本発明の第2実施例を 示す。本実施例は、ミラー15に熱電対40を取り付け ることによって、加工中のミラー15の温度をモニタす ることができる。これによって、レーザパワーの変動及 びミラー損傷を温度変化によって感知することが可能で あり、安定した加工を行うことができる。

【0017】図5には、本発明の第3実施例を示す。本 実施例は、反射膜コーティングを施した石英製ミラー4 1を用いることにより、その透過レーザビーム12 dを 金属ベース42に開けた穴を通してディテクタ43で受 けることによって、正確にレーザビーム12aのパワー をモニタすることができる。また、石英ミラー41の汚 れや損傷を感知することも可能であり、安定した加工が 実現できる。

【0018】図6には、本発明の第4実施例を示す。本 実施例は、加工ヘッド4の頭部にディテクタ44を取り 付けることによって、レーザビーム12eの配管1内面 からの反射レーザビーム12eを受けとめてそのパワー 20 の測定を行い、パワー変動をモニタすることができる。 これによって、加工点での異常を即座に感知することが でき、加工の信頼性を向上させることができる。

【0019】図7には、本発明の第5実施例を示す。原 子炉の予防保全・補修の場合、作業者の被爆低減のため に炉内に水を張っている。このため、レーザ表面処理装 置は、配管内挿入時に水密性が要求される。そこで、図 7 (a) に示すように、加工ヘッド4の頭部にOリング 45を取り付けて、配管内駆動装置46の内部に加工へ ッド4を密閉収納することで、水中で所定の位置まで加 30 エヘッド4を挿入することができる。所定の位置まで挿 入後、開閉脚47を配管1内面に押しつけて、心出し及 び固定を行う。固定後、配管内の水抜きを行い、図7

(b) に示すように加工ヘッド4を配管内駆動装置46 外部に出して、管内面レーザ表面処理を行う。

[0020]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 第1に、光学系におけるミラーは管内面に対し所定角度 に設置し、レンズは凸レンズとプリズムレンズを組合わ せ使用して、光ファイバ出射部への加工点からのレーザ 40

ビーム反射光の戻りを防ぐようにしたため、反射光によ る各種光学部品等の損傷を防止することができる。

【0021】第2に、プリズムレンズは、シリンドリカ ルプリズムレンズを使用して、レーザビームは加工点に おいて楕円ビームとなるようにしたため、幅広い表面処 理層を得ることができる。

【0022】第3に、光学系と管内面加工点との間の距 離を測定するハイトセンサを設けたため、その測定結果 を基に加工点までの距離を制御することができて安定し 10 た表面加工ができる。

【0023】第4に、シールドガス導入用のガス導入管 を光ファイバに並設し、そのガス導入管から導入したシ ールドガスを光ファイバ出射部及び光学系近傍を通過さ せて当該出射部及び光学系を冷却したのち管内面の加工 点に放出するようにしたため、装置故障を防止して加工 の信頼性を高めることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る管内面レーザ表面処理装置の第1 実施例を示す縦断面図である。

【図2】図1のA-A線断面図である。

【図3】図1のB-B線断面図である。

【図4】本発明の第2実施例を示す縦断面図である。

【図5】本発明の第3実施例を示す縦断面図である。

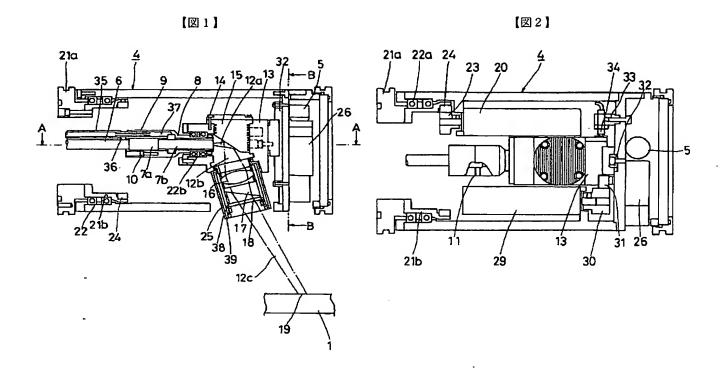
【図6】本発明の第4実施例を示す要部構成図である。

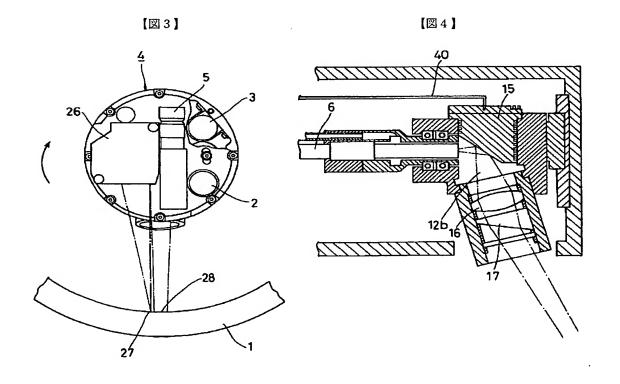
【図7】本発明の第5実施例を示す構成図である。

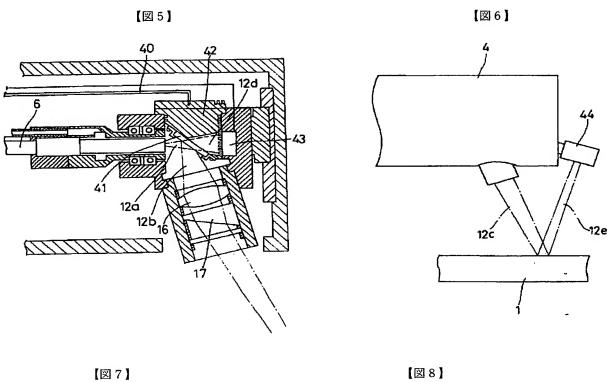
【図8】従来の管内面レーザ表面処理装置の縦断面図で ある。

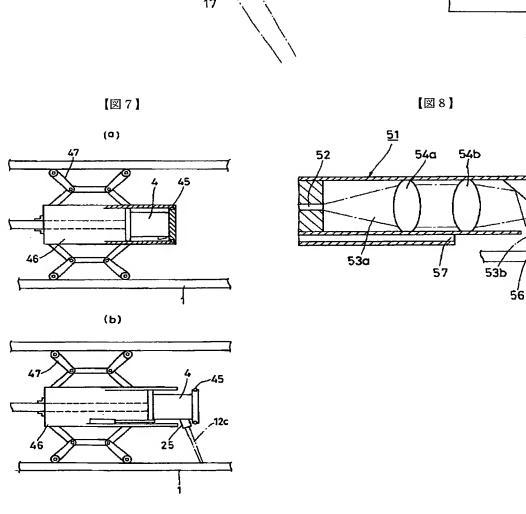
【符号の説明】

- 1 配管
- 4 加工ヘッド
 - 6 光ファイバ
 - 15 ミラー
 - 16 凸レンズ
 - 17 シリンドリカルプリズムレンズ
 - 19 レーザ照射部 (加工点)
 - 26 ハイトセンサ
 - 36 加工ガス導入管
 - 37,38 加工ガス通過路
 - 39 加工ガス出射口









(9) 日本国特許庁 (JP)

40実用新案出願公開

⑫ 公開実用新案公報 (U)

昭58—170177

DInt. Cl.3

識別記号

庁内整理番号

砂公開 昭和58年(1983)11月14日

B 23 K 9/28

9/225 31/00

7727-4E 6579-4E

6579-4E

審査請求 未請求

(全 頁)

90円形溶接治具

顧 昭57-65983

少実 後出

願 昭57(1982)5月6日

⑩孝 案 者 長長治郎

佐野市寺久保町701長製作所内

砂田 願 人 村上工業株式会社

東京都墨田区東向島2丁目16番

27号

砂出 願 人 長長治郎

佐野市寺久保町701長製作所内

砂代 理 人 弁理士 杉村暁秀

外1名

- 1. 考案の名称 円形潜接治具
- 1. 実用新案登録請求の範囲
 - 1 開閉用つまみ (14) により柱材の周囲に挟着固定しうる半円形胴体(84,86)と、
 酸胴体(84) に対し関節ねじ(82) を介し角度 関節を可能に取付けたホルダー受け(80)と、 前記胴体に腕(28) により高さ調節ねじ(80) を介して装着した案内率輪(84)を有し、前 記胴体(84,86)には回転ローラー(16) を配設して円筒形柱材の周に一定の高さで自由回動する如したことを特徴とする円形溶接 治具。



1 1

104 /

公開実用 昭和 58- 170177

8.考案の詳細な説明

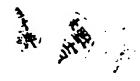
本考案は頻製手すりの円筒形柱材基部の溶接に使用するに適した円形個所の溶接治具に関するものである。

鋼製の手すりでは柱材が等間隔で並置されており、その基部は手を回しにくいので溶接作業が整かしく、とくに均等なむらのない溶接仕上げを得るに困難があつた。

本考案はかかる難点を克服するため、手すりに ローラを介して一定高さで回転するホルメーを着 脱自在とする治異を開発したものであり、これに よるときは半自動的に溶接ヘッドを回転させるこ とにより均等な溶接を行いうるようにしたもので ある。

以下図面により本考案を説明する。

第1回において、10は鋼製手すりの柱材で、 上下の枠材18の間に溶装により固定する。図は 下枠材18のみを示し、柱材10も一部のみを示 してある。柱材10は第8回に見られるように複 数本平行に設置するので適常の工法では手を回し



(

. にくい。

本考案では、点線で示す溶液電極ヘッドに対する水ルダー受ける0を調節ねじままを介し、半円筒形の胴体まらに取付け、これがつからの間にはなりではなりではなりではなったができる。の性材10に狭着した後その回りを回転する。

胴体 3 4 には解 3 8 を突散し、これに高さ調節 ねじ 8 0 と支柱 3 3 を介し案内車輪 8 4 を配設する。

高さ調節ねじる 0 で胴体 8 4 の高さ、すなわちホルダー受ける 0 の下わく上の高さを調節し、ホルダー受ける 0 に溶接電極のホルダー (図示せず)を固定し、調節ねじる 8 によつてその角度を最適に調節すれば、溶接電極ヘッドは手すり柱材 1 0 の基部と同下わく 1 3 間の溶接個所との間に取扱の間隔を保持してアークを生ずる如くして、柱材

(8)



1049

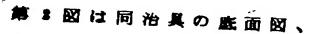
公開実用 昭和 58- 170177

10の周囲を回転し得る。

これを用いて溶接を行えは従来難かしかつた作業が極めて簡単となり、均一の溶接ができる。

第8回は作業対象の手すりの一例を示す略図である。

4. 図面の簡単な説明

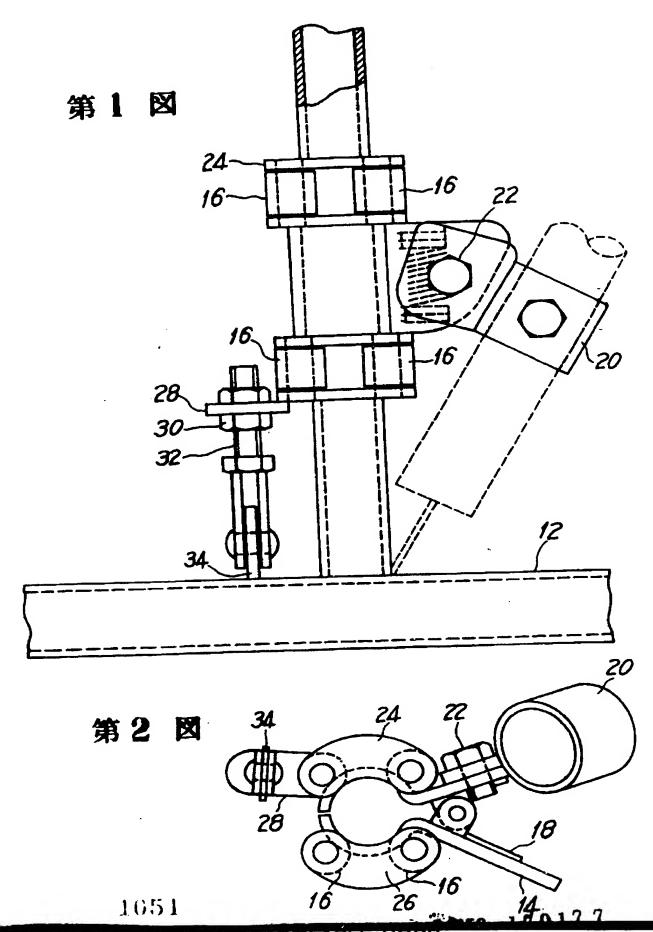


第 8 図は本考案治具の使用状況を示す説明図で ある。

- 16…回転ローラー
- 20… ホルダー受け
- 8 3 … 角度調節用ねじ
- 24,26…胴体
- 2 8 … 高さ舞節ねじ
- 8 4 … 案内車輪

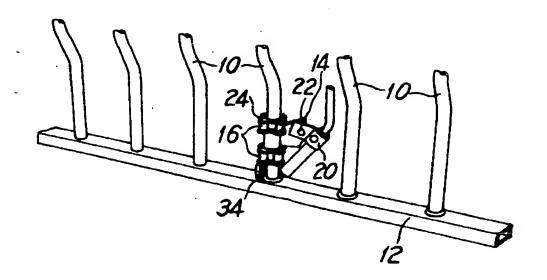


公開実用 昭和 58- 170177



BEST AVAILABLE COPY

第3 図



THIS PAGE BLANK (USPTO)